



扫描式薄膜厚度测量系统

- 适用各种透明膜，阻隔膜，非透明彩色膜。
- 5 KeV低能量高精度穿透式X线探头，安全环保、符合国家辐射源豁免管制标准。
- 准确检测10 – 200umPE或PA膜的厚度，测量精度1 ‰ 或 0.1um。
- 非接触连续测量，快速响应（1-20ms）无测量延时。



- 测量范围全覆盖，全尺寸高精度扫描架：1600mm、1800mm、2000mm、2200mm、2400mm、2600mm、2800mm。
- 高精度的核心部件，确保了测量的精度和稳定性。
- 探头内包含所有的电气元件，整个穿透式探头包含上下两个探头，安装在扫描架上。
- 上探头包含X射线检测器、自主知识产权的信号处理卡和通讯卡。
- 下探头包含X射线发射管、高压发生器、自主知识产权的信号处理卡和通讯卡。
- 探头外罩有圆形的边角，不会划伤或撕破薄膜，特别是在薄膜没有被很好的拉伸时。
- 探头采用纯净压缩空气冷却，保持探头及周边环境温度小于60℃，提高测量精度，延长使用寿命。
- 高精度伺服闭环定位控制系统，算法软件20S扫描周期内准确测量多达5000点膜厚分布曲线。

